

# 平成29年度 メカトロ技術研修 日程表

No.	月日	時間	午前 (9:30~12:30)	午後 (13:30~16:30)
			ガイドランス (9:20~9:30)	
1	6/14 (水)	6	「制御工学の基礎」(1) 市工研 計測技術研究室 山田 博行 第2研修室 (管理棟 3F)	「電気要素」 市工研 計測技術研究室 間瀬 剛
2	6/21 (水)	6	「制御工学の基礎」(2) 市工研 計測技術研究室 山田 博行 第2研修室 (管理棟 3F)	「電気回路」 市工研 計測技術研究室 間瀬 剛
3	6/28 (水)	6	「電子回路」 市工研 製品技術研究室 吉村 圭二郎 第2研修室 (管理棟 3F)	「マイコン制御」(1-1) 市工研 岩間由希、村瀬 真 第2実習室 E205 (電総センター2F)
4	7/5 (水)	6	「マイコン制御」(1-2) 市工研 岩間由希、村瀬 真 第2実習室 E205 (電総センター2F)	「マイコン制御」(2-1) ※PC 市工研 白川輝幸、間瀬 剛 第1実習室 E204 (電総センター2F)
5	7/12 (水)	6	「マイコン制御」(2-2) 市工研 白川輝幸、間瀬 剛 第1実習室 E204 (電総センター2F)	
6	7/19 (水)	6	「マイコン制御」(3) 市工研 奥村 陽三 第1実習室 E204 (電総センター2F)	
7	7/26 (水)	6	「シーケンス制御の基礎」(1) 市工研 製品技術研究室 井谷 久博 第2研修室 (管理棟 3F)	「シーケンス制御の基礎」(2) 市工研 製品技術研究室 井谷 久博
8	8/2 (水)	6	「メカトロ用センサ」(1) 市工研 電子技術研究室 小田 究 第2研修室 (管理棟 3F)	「シーケンス制御の応用」 三菱電機(株) 正親 功 氏
9	8/23 (水)	6	「メカトロ用センサ」(2) 市工研 電子技術研究室 小田 究 第2研修室 (管理棟 3F)	「画像・音響・振動センサ」 市工研 計測技術研究室 山内 健慈
10	8/30 (水)	6	「電気アクチュエータ」 足利工業大学 坂本 正文 氏 第2研修室 (管理棟 3F)	
11	9/6 (水)	6	「CAEの基礎」 市工研 電子技術研究室 岩間 由希、計測技術研究室 谷口 智 コンピュータ研修室 (電総センター5F)	(株)構造計画研究所 森 光寛 氏
12	9/13 (水)	6	「インターフェイス技術」 市工研 計測技術研究室 奥村 陽三 第2研修室 (管理棟 3F)	「機械要素」(1) 市工研 計測技術研究室 奥田 崇之
13	9/20 (水)	6	「機械要素」(2) 市工研 計測技術研究室 奥田 崇之 第2研修室 (管理棟 3F)	「生産設備における自動化事例」 三菱電機(株) 白井 靖士 氏
(実習グループ) 講師は市工研職員			Aグループ	Bグループ
14	9/27 (水)	AM 3 PM 3	「シーケンス制御Ⅰ」 市工研 吉村、山田博 第1実習室 E204	「アナログ回路」 市工研 月東、白川 第2実習室 E205
15	10/4 (水)	AM 3 PM 3	「シーケンス制御Ⅱ」 市工研 谷口、奥田 第1実習室 E204 「シーケンス制御Ⅲ」 市工研 間瀬、山内 第1実習室 E204	「シーケンス制御Ⅰ」 市工研 吉村、山田博 第2実習室 E205
16	10/11 (水)	AM 3 PM 3	「アナログ回路」 市工研 月東、白川 第2実習室 E205	「シーケンス制御Ⅱ」 市工研 谷口、奥田 第1実習室 E204 「シーケンス制御Ⅲ」 市工研 間瀬、山内 第1実習室 E204
			修了式 (16:30~16:40)・・・ 第2研修室にて	※ 予備日は10/18(水)